

レーザ協会 第204回研究会

「レーザによる表面改質と平滑化」

開催日時: 令和8年3月9日(月) 13:30~17:00

会場: 慶應義塾大学 日吉キャンパス 来往舎2階 中会議室

(神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1、最寄り駅: 日吉駅)

(<https://www.keio.ac.jp/ja/maps/hiyoshi.html>)

開催形式: 対面形式

研究会主旨: レーザによる表面改質と平滑化は、製品の信頼性向上や高機能化、低コスト化にも寄与するため、産業における重要性が高まっている。本研究会では「レーザによる表面改質と平滑化」と題し、計4件の講演を予定しています。レーザによる表面材質・応力状態の制御や表面粗さの低減に関する最新技術を紹介頂きます。万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

13:30~13:35 開会挨拶

レーザ協会会長

13:35~14:20 講演1

「レーザキャビテーションピーニング」

東北大学 祖山 均氏

14:20~15:05 講演2

「レーザピーニングの効果の紹介」

新東工業株式会社 矢野敬博氏

15:05~15:20

休憩

15:20~16:05 講演3

「水溶液を活用したレーザ誘起湿式表面改質法による金属材料への機能性付与」

三条市立大学 江面篤志氏

16:05~16:50 講演4

「レーザによる表面平滑化およびその応用事例」

慶應義塾大学 閻 紀旺氏

16:50~17:00 閉会挨拶

レーザ協会副会長

【参加費】会員: 無料 非会員: 7,000 円(当日お支払い下さい)

【申込先】レーザ協会ウェブサイト <http://jslt.jp/> の申込みフォームよりお申し込み下さい。

・参加申込〆切: 令和8年3月2日(月)

【問合せ先】レーザ協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp